

# Облікова картка ДіР



## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0218U002175

**Державний реєстраційний номер:** 0115U003166

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 30-01-2018

## II. Етап виконання ДіР

**Номер етапу:** 3

**Назва етапу:** Дослідження впливу режимів генерування імпульсів на процеси формування нанокompозитних структур

**Початок етапу:** 01.2017

**Закінчення етапу:** 12.2017

**Вид звітнього документа:** Остаточний звіт

## III. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України

**Код за ЄДРПОУ:** 14096245

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 057 7054668

## IV. Відомості про співвиконавців ДіР

## V. Відомості про замовника ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Міністерство освіти і науки

**Код за ЄДРПОУ:** 37536162

**Місцезнаходження:** пр-т Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Кабінет Міністрів України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** 406-82-00, 406-83-80

## VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

**Підстава для проведення ДіР:** 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

**Напрямок фінансування:** 2.1 - фундаментальні дослідження

### Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

**Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):** 2201040

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.):</b> 160 |
|------------------------------------------------------|

## **VII. Відомості про ДіР**

### **Назва роботи українською:**

Розробка та дослідження характеристик імпульсного високочастотного генератора для стимуляції іонно-плазмового осадження покриттів

### **Назва роботи англійською:**

Research and development of pulsed high-frequency generator for stimulate deposition ion-plasma coatings

### **Реферат українською:**

Сформовані наноструктуровані елементи із застосуванням імпульсної ВЧ стимуляції. Визначений вплив ВЧ імпульсів на якісні характеристики наноструктур.

### **Реферат англійською:**

Nanostructured elements with impulse HF stimulation are formed. The influence of high-frequency pulses on the qualitative characteristics of nanostructures is determined.

**Індекс УДК:** 621.3, 537.534.7

**Коди тематичних рубрик:** 45.01.05

### **Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:** Фаренік Володимир Іванович

### **Науковий ступінь:**

### **Вчене звання:**

### **Ідентифікатор ORCID ID:**

### **Додаткова інформація:**

## **VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)**

**Назва НТП українською:** Імпульсний ВЧ генератор для стимулювання процесів формування наноструктурованих покриттів

**Назва НТП англійською:** Pulsed RF generator to stimulate the processes of formation of nanostructured coatings

**НТП, яку передбачалося створити:**

**Причини, через які НТП не було створено:**

**Отримані результати:**

**Галузь застосування:** Електроніка

**Реєстраційний номер картки технології:**

**Опис НТП:** Високоєфективне джерело імпульсної високочастотної напруги для керування іонними процесами формування наноструктурованих елементів.

**Соціально-економічна спрямованість НТП:**

**Вплив НТП на довкілля:**

**Впровадження НТП:** Не впроваджено

**Практична реалізація НТП**

**Початок етапу:** 3 роки

**Закінчення етапу:**

**Споживачі продукції:** Приладобудівні підприємства

**Перспективні ринки:** Україна Країни Європейського Союзу

**Характер співробітництва з інвестором**

**Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:** 900

**Права, що надаються інвестору після завершення роботи:**

**Наявність бізнес-плану:**

**Техніко-економічне обґрунтування:**

**Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:** 2000

**Очікуваний термін окупності (років):** 2

**Додаткова інформація:** спільне виробництво

## **IX. Бібліографічний опис**

1. V.A. Lisovskiy, V.A. Derevianko, V.D. Yegorenkov. Positive column contraction of the glow discharge in nitrogen // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics (23). – 2017, No. 1. – P. 144-147. 2. S. Yakovin, A. Zykov, S. Dudin, V. Farenik, A. Goncharov, I. Shelest, V. Kuznetsov. Plasma assisted deposition of tab2 coatings by magnetron sputtering system // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics (23). – 2017, No. 1. – P. 187-190.5040

## **Х. Заключні відомості**

**Керівник юридичної особи**

Фаренік Володимир Іванович

к. ф.-м. н.

## **Перелік осіб-виконавців**

Казачкова Наталія Олександрівна

Кривонос Володимир Михайлович

Кропотов Олександр Юрійович

Максименко Володимир Олексійович

Турбін Петро Васильович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Телефон**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**

